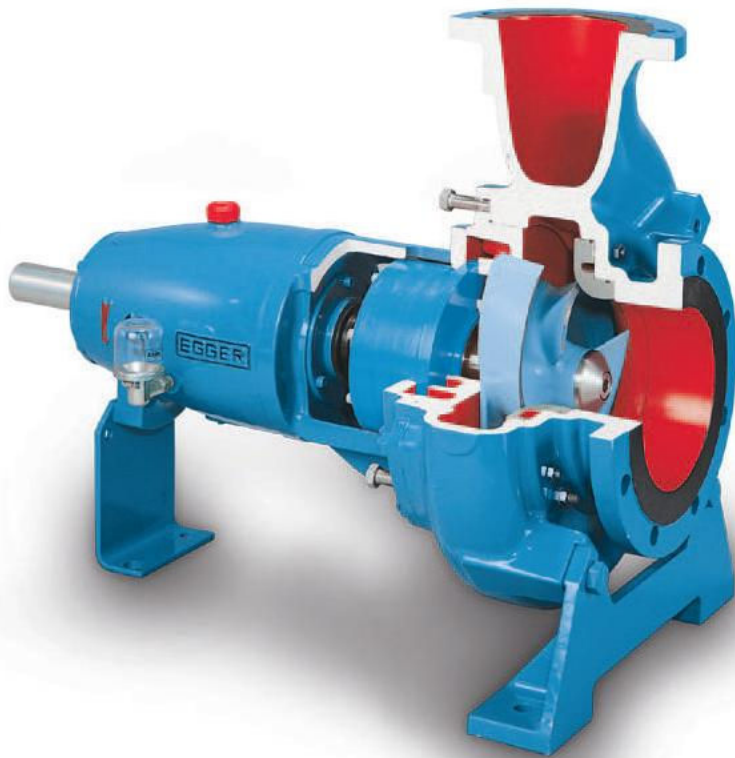


# プロセスポンプ EO/EOS

高密度固形物やガスの含有量の多い均質な流体に使用できる高性能ポンプです。  
大小様々な粒子に応じて、最適なインペラを使用することができます。



## 用途

- ・ 化学産業・石油化学産業における難易度の高い流体
- ・ 反応炉の多相混合物
- ・ 製紙・パルプ産業における空気を含む繊維懸濁液
- ・ 下水処理施設での排水及び粘性物質
- ・ スラッジ
- ・ 様々な研磨性流体、腐食性流体

## 特色

- ・ ガス含有率25%までの流体の移送が可能
- ・ セミオープンタイプのインペラ
- ・ 様々な種類のインペラ（異なるブレード数）

## 標準仕様

口径：	DN 50 - 500mm, 2 - 20"
流量：	1500 l/s, 23800 US gpm まで
差圧：	150m, 492ft まで
圧力：	30 bar, 440 psi まで
温度：	180°C, 365°F まで

## 産業・流体

エガーのプロセスポンプ EO/EOS はガスや固形物を含む難易度の高い流体を取り扱うことができます。

エガーのプロセスポンプは長年にわたり様々な産業分野で使用されています。

- ・ 化学産業
- ・ 石油化学産業
- ・ 下水処理施設
- ・ 鉄鋼業
- ・ 電力事業
- ・ 製糖産業
- ・ 自動車産業
- ・ 塗料・ニス産業
- ・ ゴム産業
- ・ 太陽光事業
- ・ 織物・繊維産業
- ・ 製紙・パルプ産業
- ・ 食品産業
- ・ 建設業
- ・ 造船業

## 特性

### 高い吸引力

プロセスポンプシリーズは、ブレードを幾何学的に配置した特殊なインペラを用いることにより NPSH<sub>R</sub> の値を低くして高い吸引力を実現させました。

### 低い消費電力

体系的な技術発展と流量の最適化により、最大 89%の全体効率を実現しました。

### ガス含有率 25%

最大25%のガスを含む流体の移送が可能です。含有率10%までは吐出圧力もほとんど低下しません。

### 高い固形物濃度

プロセスポンプ EO/EOS は固形物を取り扱うポンプとして、多量の固形物、繊維性物質、高粘度物質を含む均質な流体に適しています。

### 一定の吐出量

吸入側の外側から調整できる摩擦板が、特に高い研磨性をもつ流体に対して一定の吐出量を保証します。

### インペラモデル

一定の大きさをもつ固形物に対しては、3枚のブレードを幾何学的に配置してより広く開かれた流路を作る EOS インペラが利用できます。このシリーズには自浄機能が備わっており、繊維物質を含む流体の移送を容易にしています。

### モジュールシステム

モジュールシステムの採用により、再利用のできる様々なモジュールを保管することによってポンプを常に適切な条件で稼働させることができます。

# プロセスポンプ EO/EOS

特別な特性をもつセミオープンタイプのラジアルインペラは、1947年に創業したエミール・エガーの最初のインペラを改良し続けた結果生まれました。EO タイプと EOS タイプは主にブレードの数によって分けられますが、その水力学的特性はほぼ同じです。

## ガス含有率の高い流体の移送と高い吸引力

通常のラジアルインペラを使用する場合、ガスを含む流体の移送には制限があり、吐出量が急激に低下したり完全になくなってしまふ場合があります。1947年の創業以来、エガーはこの問題に真剣に取り組んできました。特殊なブレードを幾何学的に配置することによって、最大25%のガスを含む流体の移送が可能になり、化学産業分野における様々な反応炉の設備においてその有効性が証明されてきました。NPSH<sub>R</sub> 値が低いこともこのタイプの特徴の一つです。

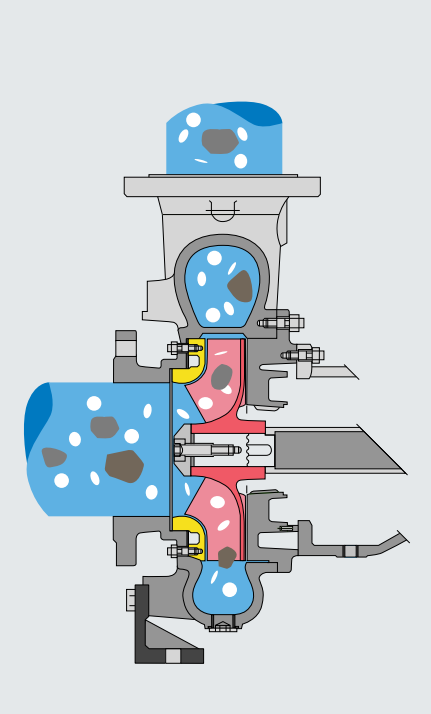
## インペラの調整により摩耗環境下でも長く持続する高い効率

セミオープンタイプのインペラの吸入側には摩耗板が取り付けられています。インペラと摩耗板の間隙は性能値(Q, H, η)の決定に極めて重要です。研磨性流体では、この隙間が徐々に大きくなりポンプの性能が低下します。EO および EOS タイプのポンプには外側から調整できる摩耗板が取り付けられており、その摩耗板で隙間を元の間隔まで狭めることができます。そのため、規定された吐出性能が回復され、長期にわたりポンプを使用することができます。研磨性の強い流体が使われる場合は、交換可能な摩耗板をケーシングカバーの内部に装着することもできます。

## インペラモデル EOS: 粒子も繊維も詰まらせないスムーズな流れ

3枚のブレードをもつ EOS タイプのポンプは EO タイプのポンプよりも流路が広く大きく球状に開かれており、主に大きな固形物を含むスラリーや懸濁液に使用されます。ブレードの先端と摩耗板は特殊な設計になっており、排水に含まれる長い繊維質の物質などの移送を可能にしています。

## 固形物を多く含む均質なスラリーに対して高い効率をもつプロセスポンプ EO/EOS



## 粘性の高いバルブの移送

製紙・パルプ産業において、エガーは数十年にわたりパルプポンプとして知られています。繊維や空気を多く含む流体は日常的に使われていますが非常に難易度の高い流体です。特殊な形状のブレードを幾何学的に配したプロセスポンプ EO/EOS は最大8%の高濃度パルプ液を安全に移送することができます。

## 多用途適用可能性

水力学の様々な特性を考慮して作り込まれたエガーのプロセスポンプ EO/EOS は今や世界中のお客様から評価される本物のプロセスポンプになっています。EO/EOS は研磨性流体、腐食性流体、粘性流体に幅広く利用できます。また、固形物を含んだ流体やガスを多量に含んだ多相の懸濁液にも適しています。高圧・高温での利用も可能です。

1102.jp - 01.2016

### 本社

Emile Egger & Cie SA  
Route de Neuchâtel 36  
2088 Cressier NE (Switzerland)  
電話: +41 (0)32 758 71 11  
ファックス: +41 (0)32 757 22 90  
Eメール: info@eggerpumps.com

### 事務所・現地法人

オーストリア	インド	スペイン
ベルギー	イタリア	アメリカ
中国	オランダ	
フランス	ポーランド	
ドイツ	スウェーデン	
イギリス	スイス (ヴァンゲン)	



詳細はホームページをご覧ください  
www.eggerpumps.com